



(19)中華民國智慧財產局

(12)新型說明書公告本

(11)證書號數：TW M413131U1

(45)公告日：中華民國 100 (2011) 年 10 月 01 日

(21)申請案號：100203649

(22)申請日：中華民國 100 (2011) 年 03 月 03 日

(51)Int. Cl. : G02C13/00 (2006.01)

B25H1/00 (2006.01)

(71)申請人：信傑貿易有限公司(中華民國) (TW)

高雄市前鎮區擴建路 1 之 27 號 13 樓

(72)創作人：莊明珠 (TW)

(74)代理人：桂齊恆；林景郁

申請專利範圍項數：4 項 圖式數：4 共 10 頁

(54)名稱

眼鏡工作裝置

(57)摘要

本創作是一種眼鏡工作裝置，包含有藉由磁力相吸引的一工作板與一量尺，該工作板上設有複數個檢測區，眼鏡可置放在各檢測區上並抵靠在量尺邊，利用量尺在各檢測區上移位而對準刻度、格線與曲線，藉此量測眼鏡的特性。

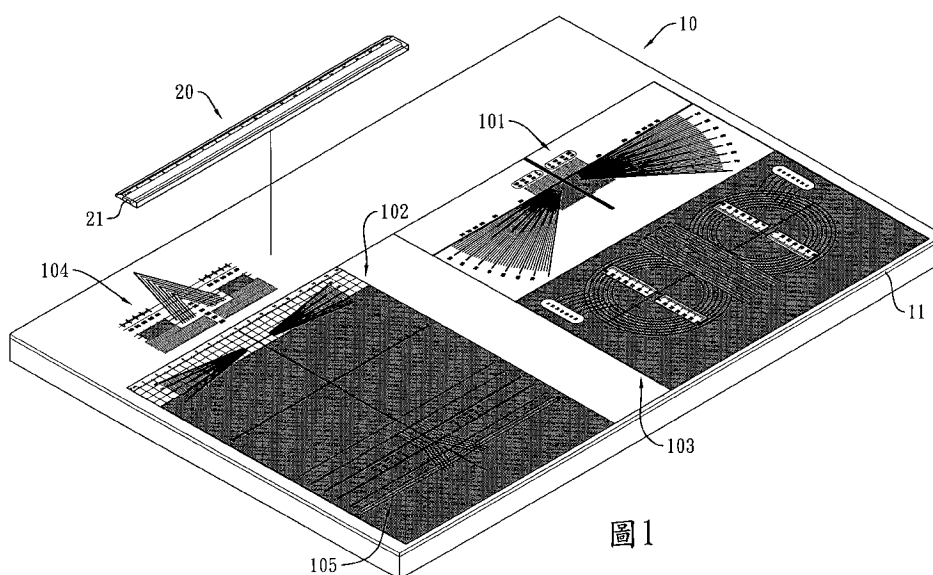


圖1

10 . . . 工作板

11 . . . 鐵片

101 . . . 第一曲度檢測區

102 . . . 第二曲度檢測區

103 . . . 焦距檢測區

104 . . . 第一鼻墊檢測區

105 . . . 第二鼻墊檢測區

20 . . . 量尺

21 . . . 磁鐵

五、新型說明：

【新型所屬之技術領域】

本創作是一種眼鏡工作裝置，特別是指利用可藉磁力相吸的工作板量尺量測眼鏡特徵的工作裝置。

【先前技術】

有些消費者當患有近視或遠視時會選擇配戴眼鏡，因每個人的頭部大小、臉型、鼻梁或雙眼焦距位置皆不同，每個人適合的鏡框、鏡片也有所不同，故每個人在選配眼鏡時，技術人員會先量測消費者頭部、臉部的形狀、特徵，配合消費者選用的鏡框而製作出符合消費者臉型的眼鏡，供消費者舒適地配戴。

技術人員大都以目測方式估計消費者的臉部特徵與雙眼焦距，惟單純以目測方式未能確實量測出最符合消費者臉部的眼鏡，可能後續導致消費者配戴不舒適，或是鏡片與眼球未準確對焦的情形，造成消費者的不便。

【新型內容】

本創作的主要目的是提供一種眼鏡工作裝置，希望改善習知由目測方式為消費者配置眼鏡，導致眼鏡不適合消費者的技術缺陷。

為達前揭目的，本創作所採用的技術手段是提供一種眼鏡工作裝置，包含有：

一工作板，設有複數個檢測區；以及

一量尺，可移動地藉由一磁力構件以磁力吸附在該工作板上。

藉此，技術人員可在工作板上放置眼鏡，並將眼鏡抵靠在量尺邊，搭配量尺在工作板上移位、對準檢測區上的刻度、格線與曲線，技術人員即可迅速判斷眼鏡是否符合消費者配戴的需求。

【實施方式】

請參考圖 1 所示，係本創作之一較佳實施例，係包含一工作板 10 與一量尺 20，該量尺 20 可由一磁力構件以磁力吸附在該工作板 10 上，於一較佳實施例中，該磁力構件可包含一層薄的鐵片 11 及一磁鐵 21，該鐵片 11 可設置在該工作板 10 上，而該磁鐵 21 可設置在該量尺 20 上，使該量尺 20 的磁鐵 21 可與該工作板 10 的鐵版 11 相吸引；或者磁鐵 21 與鐵片 11 可反向設置，即量尺 20 上可設有鐵片 11，而在工作板 10 上設置磁鐵 21，使量尺 20 可移動地藉由磁力構件以磁力吸附在該工作板上。

該工作板 10 上設有複數個分離設置的檢測區，所述檢測區包含有一第一曲度檢測區 101、一第二曲度檢測區 102、一焦距檢測區 103、一第一鼻墊檢測區 104 及一第二鼻墊檢測區 105，每一檢測區皆具有其對應的刻度、格線與曲線；其中該兩曲度檢測區 101、102 係用於檢測鏡框上兩眼鏡鏡片相對的角度，該焦距檢測區 103 係用於檢測兩眼球焦距的位置，該兩鼻墊檢測區 104、105 用於檢測鏡框的鼻墊與消費者鼻子最佳的接觸位置。

藉此，技術人員可將眼鏡置放在工作板 10 上，搭配量尺 20 在各檢測區上迅速移位而對準其上的刻度、格線與曲線，眼鏡可抵靠在量尺 20 邊而很快地被定位在工作板 10 上，技術人員即可根據眼鏡對應在各檢測區上的刻度、曲線以判斷眼鏡的特性，從而調整出最適合消費者配戴的眼鏡。

【圖式簡單說明】

圖 1：本創作之一較佳實施例立體外觀圖。

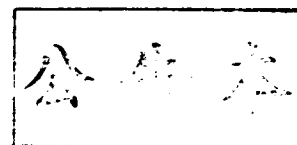
圖 2：本創作之一較佳實施例各檢測區配置圖。

圖 3：圖 2 局部放大圖。

圖 4：圖 2 局部放大圖。

【主要元件符號說明】

10 工作板	11 鐵片
101 第一曲度檢測區	102 第二曲度檢測區
103 焦距檢測區	104 第一鼻墊檢測區
105 第二鼻墊檢測區	20 量尺
21 磁鐵	



新型專利說明書

(本說明書格式、順序，請勿任意更動，※記號部分請勿填寫)

※申請案號：100203649

※申請日：100.3.03

※IPC 分類：G02C 13/00 (2006.01)
B25H 1/00 (2006.01)

一、新型名稱：(中文/英文)

眼鏡工作裝置

二、中文新型摘要：

本創作是一種眼鏡工作裝置，包含有藉由磁力相吸引的一工作板與一量尺，該工作板上設有複數個檢測區，眼鏡可置放在各檢測區上並抵靠在量尺邊，利用量尺在各檢測區上移位而對準刻度、格線與曲線，藉此量測眼鏡的特性。

三、英文新型摘要：

六、申請專利範圍：

1.一種眼鏡工作裝置，包含有：

一工作板，設有複數個檢測區；以及

一量尺，可移動地藉由一磁力構件以磁力吸附在該工作板上。

2.如申請專利範圍第 1 項所述之眼鏡工作裝置，該磁力構件包含有一設置在該工作板上的鐵片及一設置在該量尺上的磁鐵。

3.如申請專利範圍第 1 項所述之眼鏡工作裝置，該磁力構件包含有一設置在該工作板上的磁鐵及一設置在該量尺上的鐵片。

4.如申請專利範圍第 1 至 3 項任一項所述之眼鏡工作裝置，所述檢測區包含有一第一曲度檢測區、一第二曲度檢測區、一焦距檢測區、一第一鼻墊檢測區及一第二鼻墊檢測區，該些檢測區係彼此分離設置。

七、圖式：(如次頁)

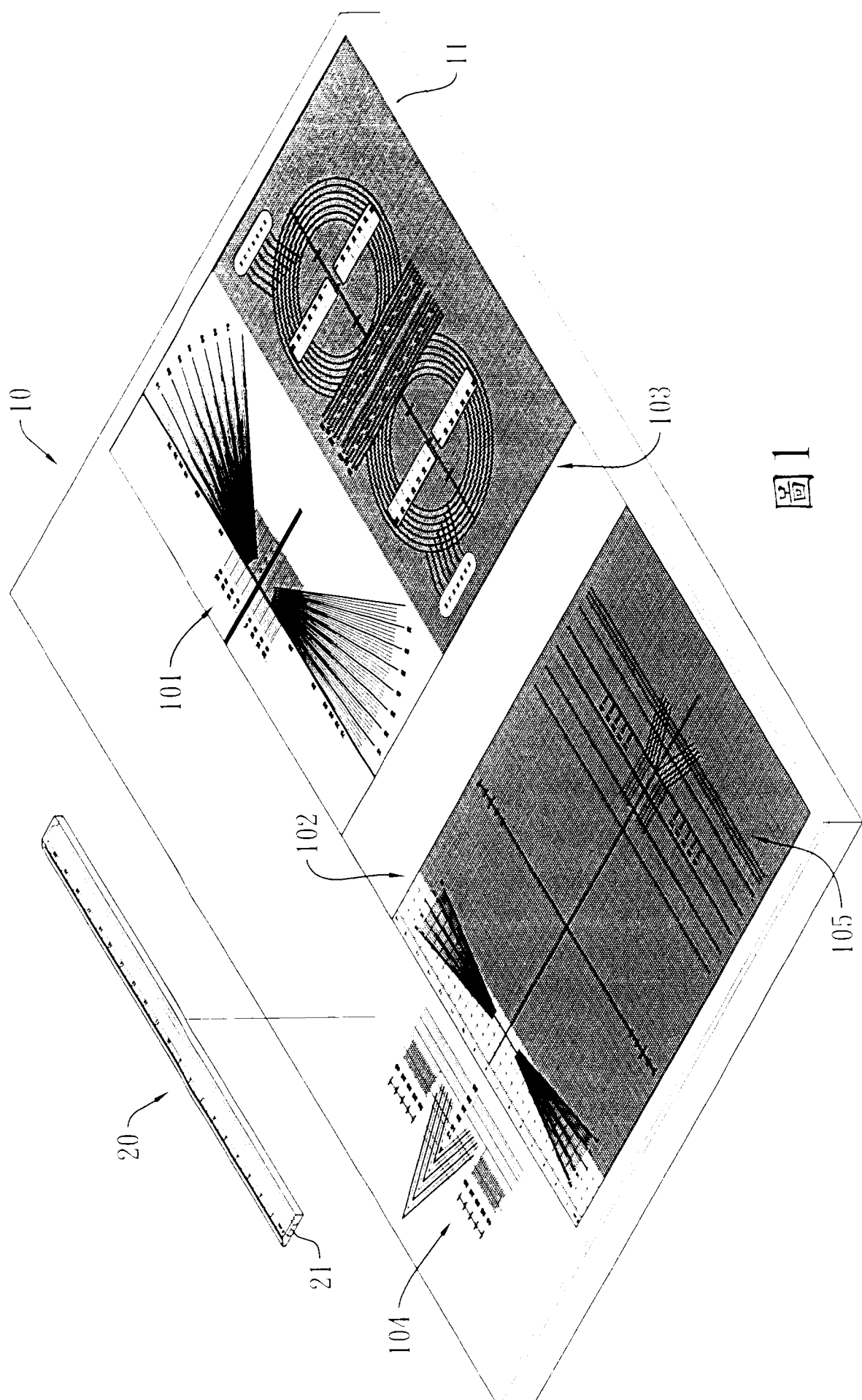


圖1

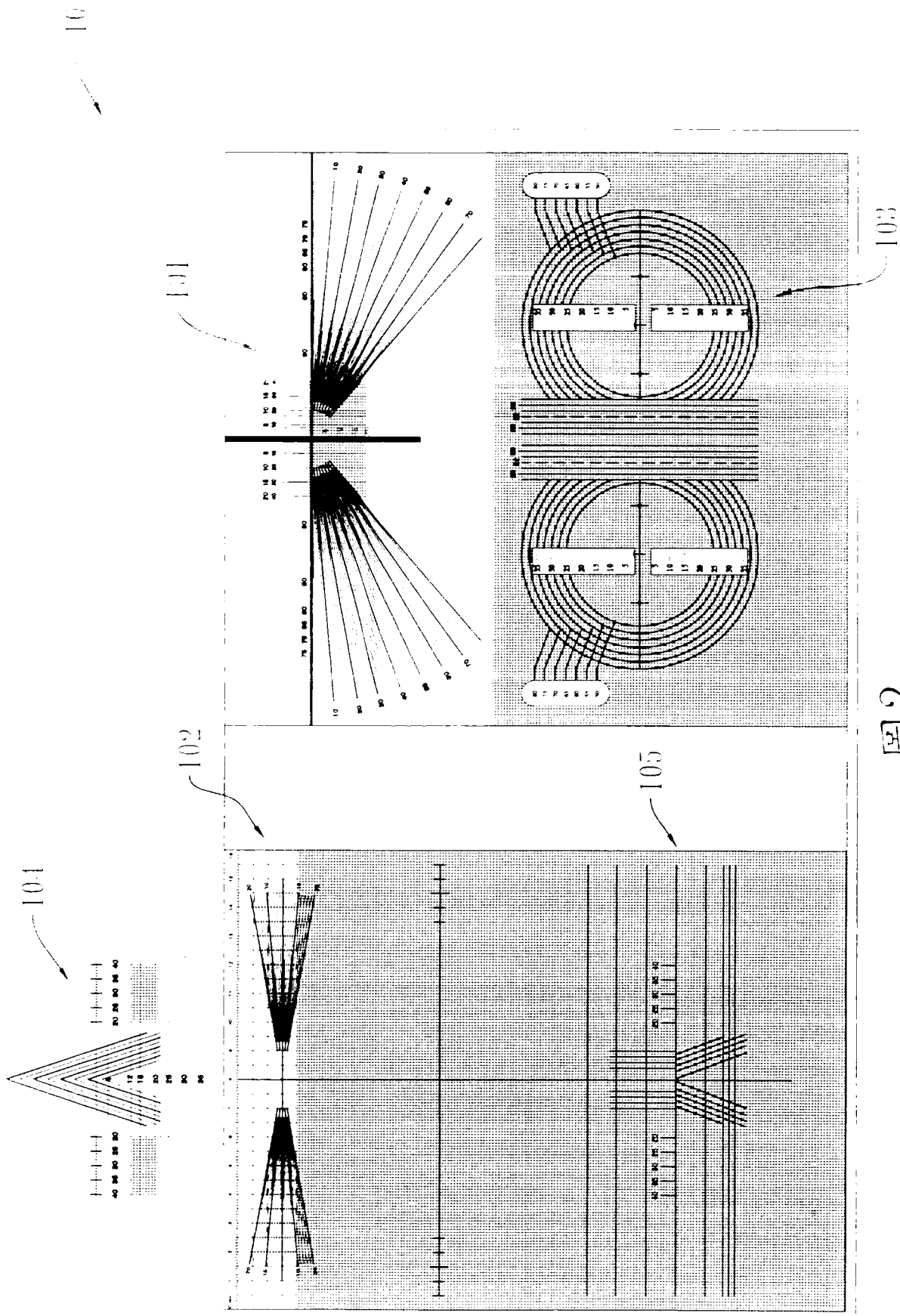


圖2

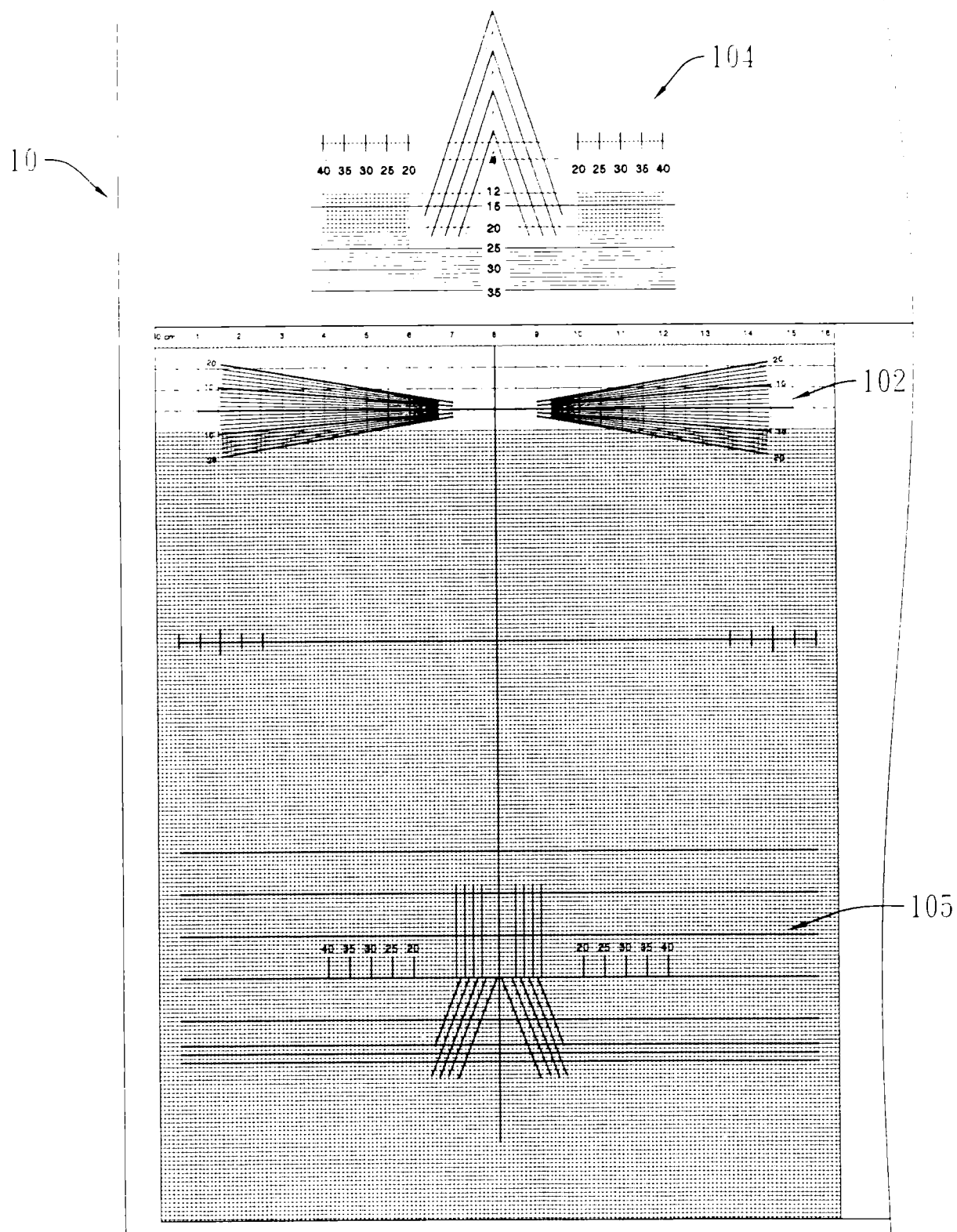
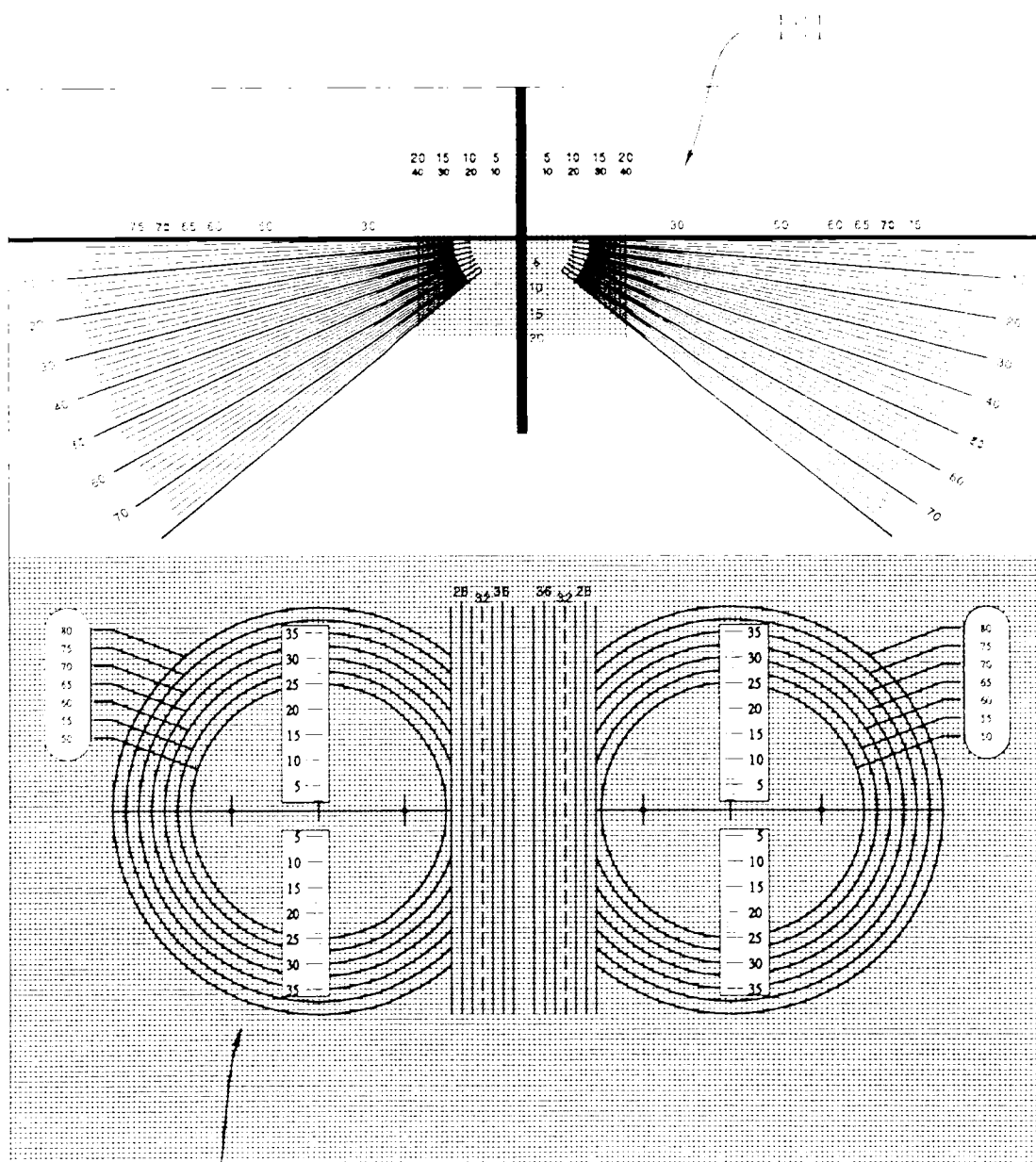


圖 3

10



103

圖 4

四、指定代表圖：

(一)本案指定代表圖為：圖 1。

(二)本代表圖之元件符號簡單說明：

10 工作板	11 鐵片
101 第一曲度檢測區	102 第二曲度檢測區
103 焦距檢測區	104 第一鼻墊檢測區
105 第二鼻墊檢測區	20 量尺
21 磁鐵	